

國立交通大學

工學院產業安全與防災學程

碩士論文

半導體金屬蝕刻機台於預防維修
時之污染物逸散控制

Controlling Pollutant Dispersion during Preventative
Maintenance of a Metal Etcher in Semiconductor Factory

研究生：古坤文
指導教授：蔡春進 教授

中華民國九十三年四月

半導體金屬蝕刻機台於預防維修時之污染物逸散控制

Controlling Pollutant Dispersion during Preventative
Maintenance of a Metal Etcher in Semiconductor Factory

研 究 生:古坤文

Student: Kwen-wen Ku

指導教授:蔡春進

Advisor: Chuen-Jinn Tsai

國 立 交 通 大 學

工學院產業安全與防災學程

碩 士 論 文

A Thesis

Submitted to Degree Program of Industrial Safety and Risk Management

College of Engineering

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

in

Industrial Safety and Risk Management

April 2004

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十三年四月